

大型精密機器高度利用公開セミナー

走査電子顕微鏡 (SEM)

講習会

JEOL JSM-IT810



日時 2026年5月14, 15日 9:00~12:00,
13:30~16:30

会場 総合研究棟II 1F 機器分析室(6)

主催 科学研究基盤センター機器分析分野

機器分析分野に新たに導入された走査電子顕微鏡(SEM)について、メーカー担当者を講師に迎え、装置の概要および基本操作を解説します。

参加をご希望の方は下記よりお申込みください。

科学研究基盤センター 機器分析分野

kiki@t.gifu-u.ac.jp

058-293-2035